

Creating a New Global Innovator

東京エレクトロンとアプライドマテリアルズが
経営統合し、「グローバル・イノベーター」が誕生

2013年9月24日



TOKYO ELECTRON



本日の発表内容

東京エレクトロン(TEL)とアプライドマテリアルズ(AMAT)による対等な経営統合

プレシジョン・マテリアル・エンジニアリング・パターニングにおいて、「グローバル・イノベーター」が誕生

株式対価による経営統合
統合新会社の時価総額は約290億ドル

統合効果と自社株買いにより、統合初年度よりEPS(1株当たり利益)の向上を見込む

経営統合による 株主価値向上

相互に補完し合う、両社の最先端
技術と製品で、半導体およびディス
プレイ産業に大きく貢献

収益性向上に向けた
両社共通のコミットメント

統合により、さらなる株主還元を実現



AGENDA

統合新会社の概要と将来性

市場の転換点を迎え、事業拡大へ布石

顧客にとって重要な先端技術を提供

統合ストラクチャーと株主価値向上

目標収益モデル

Gary Dickerson

Applied Materials, President and CEO

GM/AT&T

6 years

Manufacturing

Litho Section Mgr

KLA-Tencor

18 years

\$80M to \$2B

Inspection General
Manager: \$50 to \$500M

Worked with TEL 9 yrs

Field and Service
Group VP

Brought together best
from KLA and Tencor

President

Varian

7 years

\$500M to \$1.2B

CEO

Market share from
30% to 75%

Gained share in all
segments and all
regions

Applied Materials

1.5 years

President

Appointed CEO
in 2013

New strategy for
profitable growth

Brought together
best from
Applied Materials
and Varian

1980

1986

2004

2012



TOKYO ELECTRON



APPLIED
MATERIALS



TOKYO ELECTRON



設立:	1963年11月	1967年11月
本社:	東京	米国カリフォルニア州サンタクララ
従業員:	約12,000名	約15,000名
保有特許権:	約16,000 件	約10,500 件
年間売上高(直近12ヶ月)*:	54億ドル	72億ドル
主要技術	Track, Furnace, Wet Clean, Dielectric Etch, ALD, Wafer Prober, Display Etch, Display Track	CVD, PVD, Epi, Implant, CMP, Anneal, Conductor Etch, Defect Review, Display CVD, Display PVD
設置済み装置台数	54,000台	33,000台

1. TEL 2013年6月, AMAT 2013年7月
 2. TEL の売上高は、1US\$=¥86をベースに算出しています。



TOKYO ELECTRON



APPLIED MATERIALS

新会社について

本社所在地と 上場市場

- ▶ 東京と米国カリフォルニア州サンタクララの両本社体制
- ▶ 東京証券取引所とNASDAQ株式市場で上場
- ▶ 法人登記地はオランダ

経営陣

- ▶ 会長: 東 哲郎
- ▶ 副会長: 常石 哲男、マイケル・スプリンター
- ▶ CEO: ゲイリー・ディッカーソン
- ▶ CFO: ボブ・ハリディ

取締役会

- ▶ 11名の取締役メンバーで構成される一つの取締役会（うち7名は社外取締役）
- ▶ 5名はTELが指名する取締役（うち3名は社外取締役）
- ▶ 5名はAMATが指名する取締役（うち3名は社外取締役）
- ▶ 両社合意による社外取締役1名

モバイル環境 の進化と競争

- ▶ 高機能化
- ▶ 低消費電力化
- ▶ ユーザーインターフェイス
- ▶ モバイル機器の進化
- ▶ 適正コスト

技術的転換点 を牽引する

- ▶ トランジスタ
- ▶ 配線
- ▶ メモリ
- ▶ パターニング
- ▶ パッケージング
- ▶ ディスプレイ

両社の 得意分野

- ▶ プレシジョン・マテリアル・エンジニアリング・パターニングにおける技術革新
- ▶ デバイス性能と歩留まり向上を可能にするソリューション提供

A New Global Innovator in

Precision Materials Engineering and Patterning

- ▶ Precision films
- ▶ Precision materials removal
- ▶ Materials modification
- ▶ Interface engineering
- ▶ Scaling engineering

High-k films
Flowable CVD

Semi-batch ALD

Selective Epitaxy

Film Treatments

Co-implants
HARC etch

Reflow PVD

Millisecond anneal

Multi-patterning

Metal CMP

Integrated ALD

Hard mask films

Porous low-k films

Staircase etch

Conformal doping

両社の強みを新たに融合した
事業拡大の機会

成膜、エッチング、洗浄・待機時間ゼロ・大気暴露ゼロ



TOKYO ELECTRON



APPLIED
MATERIALS

幅広い製品ポートフォリオ

顧客の直面する課題を解決

新技術トレンド	高速・低リーク電流 トランジスタ	低抵抗・高信頼性 配線工程	3次元NAND メモリ	パターニングが可能にする 低コストの微細化
差別化可能、継続可能なソリューション	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anneal ▶ CMP ▶ CVD ▶ Epi ▶ Furnace ▶ Implant ▶ PVD ▶ Track ▶ Wet Clean 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ CMP ▶ CVD ▶ Dielectric Etch ▶ PVD ▶ Wet Clean ▶ Spin-on Dielectric 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ALD ▶ CMP ▶ Conductor Etch ▶ Dielectric Etch ▶ CVD ▶ Furnace ▶ Selective Material Removal ▶ Wet Clean ▶ Chemical Dry Etch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ALD ▶ Brightfield Inspection ▶ CVD ▶ Defect Review ▶ Dielectric Etch ▶ Track ▶ Wet Clean
	顧客重視のフィールドサービス、スペアパーツ、歩留まり向上のサポート			



エッチング分野での専門性を融合

E-chucks
Chemistry
Chamber design

Chemical delivery
Source Technology
Best Known Methods
Heaters

Integrated metrology
Chamber matching



**Conductor Etch
(Applied Materials)**
市場規模\$2.2B以上¹



**Dielectric Etch
(Tokyo Electron)**
市場規模\$1.5B以上¹



**Selective
Material Removal**
予想市場規模\$1B²

Source: 1 - Dataquest 2012, 2 - Applied Analyst Meeting 2013



TOKYO ELECTRON



Accelerating our Momentum

デバイス素材に関わる技術革新と低コストの微細化技術がモバイルの進化を可能にする

統合により優位性を増すプレジジョン・マテリアル・エンジニアリング・パターンニングが、顧客の課題をより効果的に、迅速に、より低コストで解決する

統合により、株主、顧客、従業員へ大きな価値を提供する

合併における条件

合併の構造

- ▶ TELとAMATは、オランダにて新たに登記設立される統合新会社の100%子会社となる

交換比率と所有比率

- ▶ AMAT 1株に対し、新会社の株式1.00株が割り当られる
- ▶ TEL 1株に対し、新会社の株式3.25株が割り当られる
- ▶ AMAT 株主の所有比率: ~68.0%
- ▶ TEL 株主の所有比率: ~32.0%

条件と時期

- ▶ TEL とAMAT の株主総会の承認、各国において適用される競争法に基づく関係当局による承認等を前提
- ▶ 2014年後半に完了予定

事業機会の拡大

顧客の高度化する技術的課題を解決する画期的な製品開発の機会が増大する

サービス事業の拡大

利益率成長

利益率向上に向けた相互コミットメント

統合後12カ月以内に非GAAPベースのEPS向上

統合後3年目までに税
前利益5億ドルのシナ
ジー効果

キャッシュリターン

統合後12カ月以内を目途に30億ドルの自社株買いを実施予定

新会社により投資家へのキャッシュリターン増大が可能に

顧客および株主にさらなる価値を創造

プロセス

- ▶ 経験と実績に基づく統合プロセス
- ▶ 東京とサンタクララの両本社体制
CEOの拠点を東京本社とする
- ▶ 統合された取締役会
- ▶ より早く、より効果的に、そして低コストで、ベストプラクティスを融合する

共有する価値

- ▶ グローバルな視点と企業文化
- ▶ 顧客サービスと技術革新で
豊富な実績
- ▶ 株主還元への強力なコミットメント
- ▶ 業界で優秀な人材を獲得、
育成、保持する

豊富な会社統合実績



統合によるシナジー効果

- ▶ サプライチェーンの効率化
- ▶ 製造部門の効率化
- ▶ 地域の販売およびサービス拠点の機能拡大と最適化
- ▶ IT投資と会社機能の効率化

経費削減

2.5億ドル

初年度

5億ドル

初年度からの3年間

2017年目標収益モデル (WFE \$370億)

\$182億
売上高

\$46億
営業利益

25%
営業利益率

>\$2.40
EPS

半導体製造装置、ディスプレイ製造装置およびサービス事業の収益モデルになります。(非GAAPベース)





将来の見通しに関する記述

本書には、東京エレクトロン及びアプライドマテリアルズ間の本経営統合及びそれに関連する取引その他の事項について、将来の見通しに関する記述(forward-looking statements)が含まれています。これらの記述は、期待された本経営統合の実行の方法及び条件、今後設立される本統合持株会社の執行役・取締役の就任予定者、両社の事業に関する動向や将来の業績、両社のシナジー又は類似する事項について言及しています。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「考える」、「かもしれない」「可能である」、「すべきである」、「する予定である」、「予測する」、「期待する」又はこれらに類似する表現が伴い、これらの記述の基礎となる仮定を含みます。これらの記述は、この「将来の見通しに関する記述」に述べるものと大きく相違する結果となるような、既知又は未知のリスク及び不確定要素の影響を受けるものであります。かかる要素としては、当事者の本経営統合を適時に実行する能力、当事者の関連当局の承認を適時に得る能力や両社の株主総会の承認を得る能力等の本経営統合完了の条件の充足、潜在的な訴訟の可能性(取引に起因するものを含む)、両社の運営、商品ライン、技術、従業員をうまく統合し、本経営統合によるシナジー、成長及び課税資産を実現する当事者の能力、未知、未評価又は未開示の義務や責任、両社と第三者との関係における本経営統合が公表された場合の潜在的インパクト、不確実な世界経済や事業環境、電気製品や半導体の需要、顧客の新技術や能力要件といった多くの要素に左右される本経営統合後の製品の需要レベル、(i)広範囲な製品の開発、実行及び維持並びに市場の拡大及び新規市場の開拓、(ii)事業環境への費用構造の適時な適合、及び(iii)重要な従業員に対する誘引、動機付け及び継続雇用のための両当事者の能力、その他のアプライドマテリアルズより米国証券取引委員会(Securities and Exchange Commission. 'SEC')に提出される書類、東京エレクトロンより日本金融庁に提出される書類、本統合持株会社により提出される予定のForm S-4による登録届出書に記載されるリスクが挙げられます。「将来の見通しに関する記述」は全て、現時点の経営者の判断、予測及び仮定に基づくものであり、適用法令の要請がない限り、アプライドマテリアルズ、東京エレクトロン及び本統合持株会社はいずれもこれらの「将来の見通しに関する記述」を更新する義務を負いません。

募集又は勧誘のいずれにも該当しないこと

本公表は、情報を共有することのみを意図しており、あらゆる法域において、本経営統合に伴うかどうかにかかわらず、いかなる証券の買付けの募集、売付け、引受け若しくは買付けの申込みの勧誘、又は、議決権行使の勧誘を意図するものではありません。同様にまた、いかなる法域においても、適用法令に違反して証券の売却、発行又は移転は行われません。

証券の募集が行われる場合には、必ず1993年米国証券法のSection10や日本及びオランダにおける適用法令に定める基準を満たす目論見書が用いられます。

米国証券取引委員会への重要な追加情報の提出

アプライドマテリアルズ及び東京エレクトロンは、本統合持株会社をして、米国証券取引委員会に対して、Form S-4による登録届出書を提出する予定です。Form S-4には、アプライドマテリアルズ及び東京エレクトロン間の本経営統合に関連して本経営統合に際して発行される本統合持株会社の普通株式に関する登録届出書(Registration Statement)やアプライドマテリアルズの委任勧誘状(Proxy Statement)も含まれる予定です。登録届出書には、本経営統合及びその関連事項に関する情報等の重要な情報が含まれる予定ですので、投資家及び株主の皆様におかれましては、委任勧誘状、登録届出書その他米国証券取引委員会に提出される関連文書が閲覧可能な状態になりましたら、これらの文書の全体を注意してお読みになるようお願いいたします。登録届出書その他のアプライドマテリアルズ、本統合持株会社及び東京エレクトロンが米国証券取引委員会に提出する文書は、(それらが閲覧可能な状態になった時点で)米国証券取引委員会のホームページ(www.sec.gov)にて無料で公開されます。また、これらの文書のうちアプライドマテリアルズが提出したものは、アプライドマテリアルズのIR部門(Investor Relations Department)に、郵送(住所: 3050 Bowers Avenue, P.O. Box 58039, Santa Clara, CA 95054-3299 宛先: Applied Materials, Inc.)若しくは電話(電話番号: 408-748-5227)で連絡することによって、又は、アプライドマテリアルズのホームページにおけるIRのページ(URL: www.appliedmaterials.com)を閲覧することによって、無料でその写しを取得することができ、東京エレクトロンが提出したものは、東京エレクトロンのPR部門(Public Relations Group)に、郵送(住所: 東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂Biz Tower(郵便番号: 107-6325))、電話(電話番号: +81-3-5561-7004)若しくは電子メール(アドレス: telpr@tel.com)で連絡することによって、又は、東京エレクトロンのホームページにおけるIRのページ(URL: www.tel.co.jp)を閲覧することによって、無料でその写しを取得することができます。

委任状勧誘の主体

東京エレクトロン、アプライドマテリアルズ、及び本統合持株会社とそれぞれの取締役及び執行役は、企図されている本経営統合に関して、アプライドマテリアルズの株主からの委任状勧誘の主体とみなされる可能性があります。アプライドマテリアルズの実業取締役及び執行役は、2013年1月22日に米国証券取引委員会に提出された2013年の定時株主総会のための委任勧誘状Schedule 14A、2012年12月5日に米国証券取引委員会に提出された2012年10月28日に終了する事業年度に関するForm 10-Kによるアプライドマテリアルズのアニュアルレポートに記載されています。これらの書類は米国証券取引委員会のホームページ(www.sec.gov)にて無料で公開されます。また、アプライドマテリアルズのIR部門(Investor Relations Department)に、郵送(住所: 3050 Bowers Avenue, P.O. Box 58039, Santa Clara, CA 95054-3299 宛先: Applied Materials, Inc.)で連絡することによって、又は、アプライドマテリアルズのホームページにおけるIRのページ(URL: www.appliedmaterials.com)を閲覧することによって、無料でその写しを取得することができます。本経営統合に関連する委任状勧誘の主体にかかる利害関係に関する更なる情報は、アプライドマテリアルズ及び東京エレクトロンが本統合持株会社をして米国証券取引委員会に提出させる登録届出書の中に記載される予定です。